

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成25年11月14日(2013.11.14)

【公開番号】特開2013-136032(P2013-136032A)

【公開日】平成25年7月11日(2013.7.11)

【年通号数】公開・登録公報2013-037

【出願番号】特願2011-288798(P2011-288798)

【国際特許分類】

B 01 J 37/02 (2006.01)

B 01 J 23/78 (2006.01)

B 01 D 53/94 (2006.01)

【F I】

B 01 J 37/02 301L

B 01 J 23/78 Z A B A

B 01 D 53/36 102B

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月1日(2013.10.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材と、該基材の表面に形成された触媒コート層と、を備える排ガス浄化用触媒であつて、

前記触媒コート層は、前記基材表面に近い方を下層とし相対的に遠い方を上層とする上下層を有する積層構造に形成されており、

前記触媒コート層は、貴金属触媒としてRhとPdとを備えており、

前記触媒コート層は、担体として酸素吸蔵能を有するOSC材を備えており、

前記Rhは、前記触媒コート層の上層に配置されており、

前記Pdは、前記触媒コート層の上層と下層の双方に配置されており、

前記上層において、前記Rhを担持している担体は、 Y_2O_3 を含む ZrO_2 複合酸化物からなり、

前記上層および下層において、前記Pdの少なくとも一部は前記OSC材に担持されており、

前記下層に配置されたPdに対する前記上層に配置されたPdの質量比が、0.01以上0.4以下である、排ガス浄化用触媒。

【請求項2】

前記上層および下層において、前記Pdの少なくとも一部を担持しているOSC材は、 CeO_2 または CeO_2-ZrO_2 複合酸化物からなる、請求項1に記載の排ガス浄化用触媒。

【請求項3】

前記上層に配置されたPdに対するRhの質量比が、1.25～5である、請求項1または2に記載の排ガス浄化用触媒。

【請求項4】

前記下層に配置されたPdに対する前記上層に配置されたPdの質量比が、0.06～0.32である、請求項1～3の何れか一つに記載の排ガス浄化用触媒。

